

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】令和2年1月23日(2020.1.23)

【公開番号】特開2018-98306(P2018-98306A)

【公開日】平成30年6月21日(2018.6.21)

【年通号数】公開・登録公報2018-023

【出願番号】特願2016-239776(P2016-239776)

【国際特許分類】

H 01 L 21/027 (2006.01)

B 29 C 59/02 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/30 502 D

B 29 C 59/02 B

【手続補正書】

【提出日】令和1年12月2日(2019.12.2)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0005

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0005】

【特許文献1】米国特許第7360851号明細書

【特許文献2】特開2013-175671号公報

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0044

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0044】

S203で、制御部260は、取得した配置条件に従ってディスペンサ230を制御して、基板40上にインプリント材231を配置する。S204で、制御部260は、アライメントスコープ232に、型30のアライメントマーク31と基板40上のインプリント材231との相対位置を計測させる。S205で、制御部260は、この計測により得られる相対位置とS202で取得された相対位置とに基づいて、基板ステージ220を駆動する。例えば、制御部260は、アライメントスコープ232により計測される相対位置とS202で取得された相対位置との距離が許容範囲内に収まるように、基板ステージ220を駆動する。